

Title (en)

Method of manufacturing a control plate for the gas-tight fitting into a display device.

Title (de)

Verfahren zum Herstellen einer Steuerscheibe zum gasdichten Einbau in eine Anzeigevorrichtung.

Title (fr)

Procédé de fabrication d'une plaque de commande pour installation dans un dispositif indicateur imperméable aux gaz.

Publication

EP 0199077 A1 19861029 (DE)

Application

EP 86103594 A 19860317

Priority

DE 3510783 A 19850325

Abstract (en)

Method of manufacturing a control plate for gas-tight installation into a display device. In a method of manufacturing a control plate (2) for gas-tight installation into a display device, whose control lines consist of a Cu lower layer and an Ni upper layer, it is proposed that, in the case of galvanic deposition of the layers onto the control plate (2) clamped into the screening frame (1), an additional screening (3) is carried out, when the Ni upper layer is applied, in the areas in which the glass solder seams are provided for the gas-tight installation. The method according to the invention is used in the manufacture of flat plasma picture screens. <IMAGE>

Abstract (de)

Bei einem Verfahren zum Herstellen einer Steuerscheibe (2) zum gasdichten Einbau in eine Anzeigevorrichtung, deren Steuerleitungen aus einer Cu-Unterschicht und einer Ni-Oberschicht bestehen, wird vorgeschlagen, daß beim galvanischen Abscheiden der Schichten auf die in Abschirmrahmen (1) eingeklemmte Steuerscheibe (2) beim Aufbringen der Ni-Oberschicht eine zusätzliche Abschirmung (3) in den Bereichen vorgenommen wird, in denen die Glaslotnähte zum gasdichten Einbau vorgesehen sind. Das erfindungsgemäße Verfahren wird bei der Herstellung von flachen Plasmabildschirmen angewendet.

IPC 1-7

H01J 17/49; C25D 5/12

IPC 8 full level

H01J 15/00 (2006.01); **H01J 9/14** (2006.01); **H01J 15/02** (2006.01); **H01J 17/49** (2012.01)

CPC (source: EP)

H01J 9/14 (2013.01); **H01J 17/498** (2013.01); **H01J 2329/00** (2013.01)

Citation (search report)

- [AP] DE 3341397 A1 19850523 - SIEMENS AG [DE]
- [A] DE 3321888 A1 19841220 - SIEMENS AG [DE]
- [A] WO 8200919 A1 19820318 - LUCITRON INC [US]

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0199077 A1 19861029; JP S61220241 A 19860930

DOCDB simple family (application)

EP 86103594 A 19860317; JP 6384386 A 19860320